

용도설명 및 구매사양서

1. 품 명	(국문) Gas cluster ion beam 고전압 발생 모듈 (영문)		
2. 수량/단위	1 M/D	3. 금 액	원
4. 연구과제명	3차원 분자 이미징 질량분석기 개발	5. 품 목 번 호 (H S K No.)	
6. 제작회사명 (국 명)			
7. 국내제작 가능 여부	Y	8. 기기의 중복 보유여부	N
9. 사용용도/ 내구년수	Gas Cluster ion beam 방출을 위한 고전압 발생 모듈/3년		
10. 품명 및 세부사양		단위	수량
A.기본구성사양 1. Gas cluster ion beam 고전압 발생 모듈 구매 - Acceleration Voltage : 30kV Floating Heater Power Supply 7V/3A(21W) B.기타사양 1. GCIB Main Power Supply 가. Acceleration Voltage : 30kV 나. Floating Heater Power Supply 7V/3A(21W) 다. Floating Electron Acc. Power Supply : -500V(30mA/25W) 라. Floating Ion Extraction Power : -4kV(5W) 마. Floating E.I. Backing Power : -300V(30W) 바. Floating Capping Electrode : 300V(5W) 기타사항 : 6U / 19" 표준 Rack / PC Control(Manual Control 가능) / LCD 2. Lens Power Supply 가. First Lens Power Supply : 20kV 나. 2nd Lend Power Supply : 20kV 다. CEM Detector Power Supply : 3kV 기타사항 : 3U / 19" 표준 Rack / PC Control(Manual Control 가능) / LCD 3. Beam Control Power Supply(WIEN/SED/PMT/STIG) 가. WIEN Filter Control Power Positive : +800V(10W) 나. WIEN Filter Control Power Positive : -800V(10W) 다. SED Power Supply : 10kV 라. Stigmator : -40V ~ 40V (8CH) 마. PMT Reference Control : 5V 기타사항 표준 가능 기타사항 : 3U / 19" 표준 Rack / PC Control (Manual Control 가능) / LCD 4. HV Deflection Amplifier 가. Output : 4CH (-200V ~ +200V), +X, -X, +Y, -Y 나. Rising Time(slew rate) : 500V/us 다. Input : X, Y(±5V) 라. Gain : 40 마. Over Current Protection 바. Arc Protection 기타사항 : 2U / 19" 표준 Rack 5. HV Switching Power		M/D	1.

가. Output 1 : -500V / +500V Pulser(0~ 500V Control) 나. Output 2 : -3kV CEM Power Supply(DC) 나. Rising Time(slew rate) : 50ns at 0 to 500V 다. Input : TTL Pulse 라. Arc Protection 기타사항 : 2U / 19" 표준 Rack / PC Control / Manual Control 6. HV Power Supply (Magnum Power Supply) 가. Output 1 : -3kV 나. Output 2 : +6kV(2CH) 다. Output 3 : 3kV(2CH) - 전체 : 5ch High Voltage Power Supply 마. Arc Protection 기타사항 : 2U / 19" 표준 Rack / PC Control / Manual Control(LCD) 7. 기타사항 - 19: Rack Full size - RS232 : 3 CH - PC Software Demo 및 Protocol 제공		
① 현장 납품(O) , ② 현장 설치(O) , ③ A/S필요(O) , ④ 기타()		